

※課題番号 : F-12-KT-0120
※支援課題名 (日本語) : MEMS デバイスの作製プロセス開発
※Program Title (in English) : Process development of MEMS devices
※利用者名 (日本語) : 高田 英一
※Username (in English) : Eiichi Takata
※所属名 (日本語) : 株式会社村田製作所
技術・事業開発本部 商品開発統括部 プロセス開発課
※Affiliation (in English) : New Technology & Products Development Group,
MURATA Manufacturing Co.,Ltd.

※概要 (Summary) :

【相談内容】MEMS デバイスの小型化のために、ドライエッチングとウェットエッチングを用いて、微細パターン加工を行ない、加工条件、加工速度、形状を明確にしたい。

希望利用装置

- ・ドライエッチング装置
- ・ウェットエッチング用ドラフト

【回答】利用目的には、ドライエッチング装置としてナノハブ設備が適していると思われる。段差計やSEMも併せてご利用いただければ、同時に評価も可能である。

【結果】H24 年度自主事業として利用。

※実験 (Experimental) :

技術相談の為割愛

※結果と考察 (Results and Discussion) :

技術相談の為割愛

※その他・特記事項 (Others) :

なし